(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—32319

DInt. Cl.3 C 01 B 33/02 #H 01 L 21/18 27/14 識別記号

庁内整理番号 6765-4G 6851-5F 6824-5F

43公開 昭和56年(1981)4月1日

発明の数 2 審査請求 有

(全 5 頁)

69ケイ素材料の精製方法

20特 願 昭55-99986

22出 願 昭55(1980)7月23日

優先権主張 201979年8月16日30西ドイツ (DE) 30 P2933164.4

ヨーゼフ・デイートル 72発 明 ドイツ連邦共和国ノイエツテイ ンク・アム・ベーレンパツハ17

ミヒアエル・ヴオールシユレー 明 72発 ゲル

ドイツ連邦共和国ウンタープフ

レクトロヘミツシエ・インドウ ストリー・ゲゼルシヤフト・ミ ツト・ペシユレンクテル・ハフ ツング・

⑪出 願 人 コンソルテイウム・フュア・エ

ドイツ連邦共和国ミユンヘン70 ツイールシユタツトシユトラー セ20

アツフエンホーフエン・フリー

ドラントシユトラーセ13

個代 理 人 弁理士 佐々木清隆 外2名

1. [発明の名称]

ケイ素材料の精製方法

2.〔 特許請求の範囲〕

1. 太陽電池製作用のケイ素材料を酸溶液によ る長出によつて精製する方法において、本来公知 の化学的精製段階と、10-6~10-4パールの圧 カ下、1500~1700℃の温度における真空蒸 発とを組合わせて行うことを特象とする精製方法。

- 2. 真空蒸発を鍛による慶出の後に続けて行う ことを特徴とする特許請求の範囲薄1項配収の方 生っ
- 3. 精製すべきケイ糸材料を20~60 umの 粒度にまで粉砕することを特徴とする特許請求の 範囲第1項または第2項に記載の方法。
- 4. 酸容板として、水性塩酸とフッ水性化水素 観との混合物を用いることを特徴とする特許請求 の範囲無1点から無る頂までの何れか1項に記載 の方法。
 - 5. ケイ染1%につき酸格板1~10~を加え

ることを特徴とする特許請求の範囲第1項から第 4 項までの何れか1項に記載の方法。

- 6. 精製すべきケイ素材料に付加的に方位性樹 化を行うことを特徴とする特許請求の 郵酬第1項 から乗5 自までの何れか1 頃に配破の方法。
- 7. 容融るつぼを加熱領域から20~40 m/ if の速度で下降させることによつて方位性値化を行 うことを特徴とする特許請求の範囲第6項記載の 方法。
- 8. ホウ素含量の高いケイ素材料を最初に俗魁 し、次に抽出用俗融物と接触させることを特徴と する特許調求の範囲第1点から第7項の何れか1 項に配収の方法。
- 9. 抽出用熔融物として、フツ化カルシウムと ケイ酸カルシウムとの混合格融物を用いることを 特徴とする特許請求の範囲第8項配収の方法。

3. [発明の辞細な説明]

本発明の対象は太陽電池製造用のケイ素材料を 酸溶液による侵出によつて精製する方法である。

本発明は先ず第一に太陽電池によるエネルギー

(2)

持開昭56- 32319(2)

発生と関連して考慮されるべきものであるo この ような太脚電池化よつて電気エネルギーと経済的 に競台し得るエネルギーを供給し得るためには、 十分に安伽なペース材料のケイ繁を使用に供する ことが必要であるが、地球上にSiO2として実際 に無尽波な量で存在するケイ素は先ず離元してか ら、精製しなければならない。 病度な電子工学用 デバイスの製造に頭常用いるようなケイ素材料の ガス相を終る精製は、あまりにも費用がかかりす ぎるために、問題外とされるが、太陽電池用ケイ 妻の顧声にはこのようなぬい要求はなされていな いので、これより費用のかからない方法を適用す ることができる。例えば、ケイ紫材料の精製方法 として、贈または酸准合物による処理から成る方 法が公知である(例えばスイス特許第567435 号明州書、米国特許第2972521号明細書およ び L. P. Hunt 等による " 冶金品質 ケイ素から太陽 電池品質ケイ素への精製"太陽エネルギーの国際 シンポジウム会報 1976年参照)。 しかしなが ら、これらの方法では、太陽電池の製造に十分と

(3)

~10⁻⁴ パールの圧力下で1500~1700℃ の温度における真空基発と組合わせることによつ て解決することができる。

精製のためにケイ素に真空処理を行うことは、すでにL. P. Hunt等によつて研究されているが(Dow Lorning 社、Quart、Report M.2 ERDA/JPL/954559 - 76/1977年1月2日号)。これらの研究者による方法では精製効果を始んと挙げることができないので、原則としてこのように方法は設ましくないと彼らも勧告している。

本条明の方法によると、ケイ紫がケイ紫含量95 順間場以上と埋海される治金品質ケイ素であるケイを材料を合同的に、資ましくは20~60 μm の範囲内の複度(20 μm 以下の複度のものは5重 電力以下)にまで粉砕し、破水管板を加える。この噂としては、特に塩質およびフッ化水素酸を単独または増ましくは混合物として、特に約3:1~1:2のモル比の混合物として用いるのが適している。 中間は5~20谷最男の費水路板として、

は云えない純度のものが祖られるばかりでなく、 非常に長い処理時間が必ずであつた。

ヨーロッパ特許出帕旗2135号には、ケイ寮を金属客機物中に加え入れ、この客機物中から時結晶し、抽出用器融物によつて処理し、次に解職物から偏析を利用して特製することから放る、ケイ繁材料の精製方法が述べられている。この特託出願には費用のかからないケイ素の模製方法を扱つている他の文献も多く紹介されている。

また、個ドイツ公開馬2729464号公園にもケイ案の精製方法が述べられているが、この方法では本米公知の化学的精製設備を行う前に、ケイ素を解観し、次に様々に希却して再び応化させており、この方法ではケイ素の各製物を抽出用解製物と接触させることもできる。

それ故、本希明は先行技術に比べてかなり低い 費用でかつ終容できる処理時間において、高い純 度に導びくような。ケイ素材料の精製方法を提供 することである。

この課題は、本来公知の化学的精製安階を10⁻⁶ (4)

またフッ化水業修は2.5~10谷量%の酸水等等として用いるのが合目的であるが、両者の酸水等額の混合物の場合は、混合物の水分含量に関しては当然また別の割合が生ずる。

約1kgのケイ素材料に約1~10 Lの療准合成 を加えることが、有利であると刊明している。 処 理時間は艦肢に依存しており、例えば20℃にお いて約4~48時間であるが、80℃においては 約1~24時間に短縮することができる。処理過 程間に使用された酸の全体まだは1部を併出して 期解な確または混合物成分と入れ歩えることがで きるoこの処理時間後に脚を除去し、得られた粉 宋が廖を含まないように疣夢する。この方在の望 ましい態様としては、この酸処理を原則的では真 空過程の次に行うことができるとしても、このよ うに予め物製した粉末を密製してから、真空奏発 を受けさせるものであるが、この方生の方が真空 処理の後に低動状に発生するケイ紫を直接に ― 場合によつては付加的なドーピングを行つた後に — 太陽電池用小プレートに鋳造できるので大抵

(6)

の場合望ましい。

歴処理後に得られたケイ製粉末を次に、例えば アルゴン、選業またはこれらの混合物のような保 護ガス下で、常圧または常圧よりやや一約0.3パ ールまで一被圧した圧力において容融する。次に、 圧力を徐々に成ずるが、もし徐々に行わない場合 にはケイ繋容融物に含まれる不純物のために、し ばしば負動なガス化を生ずる恐れがある。

適当なるつぼ材料としては例えば、係い密度を有するかまたは孔質でない物質を塗布できる無鉛、 炭化ケイ素または窒化ケイ繋が挙げられる。また、 るつぼ中の溶験物の深さは約30cmまでが有利で ある。例えばケイ酸カルシウム/フッ化カルシウムの保護屈融物を任意に盤布した無鉛スターラー によつて、または中位の関波数範囲における誘導 積粋によつて容融物を攪拌する場合には、勿論さ らに深い容融物探さで行うことができる。

約 10^{-6} ~ 10^{-4} パールの低圧に達した後に、 ケイ紮容融物の英発を約0.5~2 時間にわたつて 有利に行うことができる。

° (7)



また、真空蒸発後に加熱領域から徐々にあつば 全体を下げることが特に望ましく、この場合ににも 間側された条件下で固化した租牧な精製をに応い 初られる。この場合に、接入物の大きされるのが有 か20~40mm/時の下降速度で操作するのが有 利である。この実施態様するのが、この が固分に不絶物が響積するので、とは除分に不 組して再び出発物質に加えるかまたはを かればならない。加熱るつぼをささるの状態 ればならない。加熱るつぼをささるとに不 のですでに折出しており、 のですでに折出しており、 のでするのではなく、 はたのではなく、 はたついである。 はたってはなく、 はたってはなく、 はたってはなく、 はたってはあのかまたは があるのではなく、 ののではなく、 はたっていていているののは がある。 として行うのではなく、 はたっているのの はたいである。

精製すべき治金品質ケイ素が、太陽電池ベース 材料の場合に絶対的なより集合量と理解される。 約10ppm以上の高いより集合量を有している場 合には、番融ケイ素を抽出用路融物にも接触させ ることが有利である。抽出用超融物による処理は 必要に応じて行われるものであるが、最初の段階 特開昭56- 32319(3)

このように精製したケイ紫は次に一例えば西ドイツ公告第2508.803号公報に従がつてー 小ディスクまたはインゴットとしての太陽電池ペース材料に直接調査することができる。

他の精製法としては例えば、쯈融物からケイ案 棒を引上げることから成る、公知の * Czochralski 法 * (W. R. Runyan による * ケイ製半導体テクノ ロジー * 34~39頁。McGraw Hill 出版。1965 年)に従つて常融ケイ素に方位性ある歯化を生じ させることによつて精製を行うことができる。と の方法で単結晶成長が望ましい場合には、単結晶 を密融物の表面下に沈め、回転させながら、この 単結晶上に折出するケイ繋を纒の形状に折出させ るのであるが、太陽電池材料としては単結晶成長 が必らずしも必要ではないので、最大約100 m /時まで、望ましくは約50~75㎜/時の速い 引上げ速度を通用して、純度が高く、粗粒な結晶 性材料を得ることが可能である。溶融物の最後の 約10容量あは不顧物がこの部分に審権している ので、冶金品質ケイ素に戻し入れるのが望ましい。

(8)



として行うのが合目的である。再び配化したケイ 晏を次に細かくすり砕き、鬱で処理し、再び客融 してから、真空蒸発によつて再精製する。抽出用 母触物としては、例えばケイ酸カルシウムおよび ケイ酸マグネシウムのようなケイ酸アルカリ土。 毎に例えばフッ化カルシウムおよびフッ化マグネ シウムのようなフッ化アルカリ土、ならびに例え ばフッ化カルシウムとケイ酸カルシウム、フツ化 マグネシウムとケイ酸マグネシウムならびにケイ 酸カルシウムとケイ酸マグネシウムとから成るよ うな混合溶触物が適している(例えば西ドイツ毎 計第1022806号明細書ならびに米国特許第 3871872号明細書参照)。 ケイ酸カルシウ ムを30~10重量男(混合溶融物に関して)含 有するフッ化カルシウムから成る混合溶触物を酸 化性雰囲気下で用いた場合に、特に良好な結果が 得られる。

抽出時間は約0.5~1時間、温度は約1450~1600℃であることが望ましい。 ケイ素に対する抽出用症触物の輸出は1:3~10:1の範

00



特開昭56- 32319(4)

脚で選択することが望ましいo

吳 鄉 例 1.

8 風量 tpm のホウ 器含量を有するケイ素材料を 先ず最初にジョークラッシャーで粉砕し、振動撃 砂ミル中で20~60 μmの範囲の平均构度を有 する粉末になるもですり砕くo このケイ素材料粉 . 米を、20年時必の塩糠54と10年時必のフッ 「化水素螺50とから製造した酸混合物によつて、 8月 Cにおいて1日時間撹拌しながら浸出を行う。 次が、この粉末を遠心流浄機内で酵が無くなるま で优争して、乾燥する。次に、この粉末を誘導加 熱真空祭殿裝備内で、0.65パールのアルゴン不 **尚性ガス芽囲気下において容躱し、容融物を1600** でに維持した。この操作間に熔敏物は内径15mm の黒鉛るつぼ内に12mの密報物保さで存在した。 3 D 分間内に圧力を徐々に低下させることによつ $\tau = 10^{-5}$ パールの真空に调節した。この場合、 約1時間かかる真空蒸発は黒鉛機拌機を用いて密 脚物を撹拌することによつて促進することができ to

αŊ

润 1 表

純度表示(重數ppm)

| 兀索 | ケイ変材料 | 美施州 1 | 美施例 2 |
|-----|-------------|-------------|-------------------|
| -/ | 7 1 7 11 11 | × 1/4 /10 | 美/版 [71] Z |
| Fe | 3500 | 1, 5 | 0,2 |
| A 1 | 1200 | ' <1 | < 0,2 |
| Ca | 1500 | <1 | < 0,5 |
| Mn | 300 | < 0,5 | < 0,1 |
| Тi | 300 | 0,5 | < 0,1 |
| Ur | 4 0 | < 1 | < 0, 1 |
| Сu | 40 | < 0,5 | < 0,1 |
| B | 8 | 8 | 7 |
| P | 3 0 | < 1 | < 1 |

実施例 3.

30重電 ppmのホウンで重を有するケイ業材料 5 kpを誘導加熱黒鉛るつば内において、CaF2 4 kp + LaO 3 kp + SiO2 3 kp から成る、工業的純版の 抽出用が触物と氏に容配し、1450~1500 で の範囲の偏載に約30分間、容融物を接触させて 次に、ケイ素経触物を態度勾配の作用下で鍛売して、太陽増也用に乗した柱状構造を有するインゴットを作製した。このインゴットを切断して、小ディスクをホウ業ドーピングを有する太陽電池を形成するように加工した。 物処理に続けて 単学 法発を行うことによる本発明の特製方法の成果は第1級から明らかである。

実施例 2.

8 乗勧 PPMのホウ 美含量を有するケイ 条材料を実施例 1 と同様に粉砕、 零品し、 砂で漫出を行つてから、 真空処理した。 次に無約るつぼを加外領 敬から 2 5 mm / 時の速度で下降させることによって、 ケイ 美容融物に方位性の ある歯化を行つた。このようにして形成された結晶構造は、 柱状に配位した大きい 粒度を示した。 ケイ素の最初に歯化した半分の純減は第 1 表に記載した。 このケイ素 から小ディスクを切断し、 ホウ素ドーピングを有する太陽電池に加工した。

02

保持した。この容融物抽出試験化性雰囲気(空気) 下で行つた;(この操作は燃焼によるるつぼ損傷 を滅ずるために、窒素雰囲気下で行うこともでき る)。

抽出明間後に、フツ化カルンウムーケイ博力ルシウムー客機物からケイ素を鋳込みによつて分離し、 無鉛チル中で徐々に動電する。次に実施例1と同様に兼処理、真空処理を行つて、更に稍衰する。 続いて、ケイ素容融物をインゴット状に両難し、 これを小ディスクに切断して、これから太陽電池 を作数する。 敏初に含まれていた不他物成分に調 して、得られた視版を単2歳に記せする。

筆 2 港

純度表示(電視 ppm)

| 兀声 | ケイ芸材料 | 寒腑例 3 |
|----|---------|-------|
| Fe | 0 0 0 3 | 1 |
| Αì | 1500 | < 1 |
| Ca | 1500 | < 1 |
| Mn | 300 | < 0,5 |
| Ti | 3 0 u | 0,5 |
| Jr | 4 0 | < 1 |
| Cu | 4 0 | < 0,5 |
| В | 3 0 | 8 |
| P | 3 0 | < 1 |

代 埋 人 并埋土(8107)佐 本 有 優 (はか2名) (はか2名)

(15)

Japanese Unexamined Patent Publication (Kokai) No. 56-32319

Publication Date: April 1, 1981

Title of the Invention:

PURIFICATION METHOD OF SLICON MATERIAL Claims:

- 1. A method for purifying a silicon material for producing a solar cell by leaching with an acid solution, characterized in that a chemical purification stage known in the art and vacuum evaporation at a pressure of 10^{-6} to 10^{-4} bars and a temperature of 1,500 to 1,700°C are carried out in combination with each other.
- 2. A method according to claim 1, wherein said vacuum evaporation is carried out after and in succession to said leaching by the acid.
- 3. A method according to claim 1 or 2, wherein said silicon material to be purified is pulverized to a grain size of 20 to 60 $\mu m\,.$
- 4. A method according to any of claims 1 through 3, wherein a mixture of aqueous hydrochloric acid and hydrofluoric acid is used as said acid solution.
- 5. A method according to any of claims 1 through 4, wherein 1 to 10 liters of water is added to 1 kg of silicon.
- 6. A method according to any of claims 1 through 5, wherein azimuthal solidification is additionally carried out for said silicon material to be purified.
- 7. A method according to claim 6, wherein said azimuthal solidification is carried out by lowering a

melting crucible from a heating area at a rate of 20 to 40 $\,$ mm/hour.

- 8. A method according to any of claims 1 through 7, wherein a silicon material having large silicon content is first molten and is then brought into contact with a molten matter for extraction.
- 9. A method according to claim 8, wherein a molten mixture of calcium fluoride and calcium silicate is used as said molten matter for extraction.